NAFHW1D-100规格

项　目	NAFHW1D-100
行　程	±3mm
平台尺寸	196.5mm(D)x80mm(W)x46.5mm(H)
绝对定位精度 ※1	3μm
重复定位精度	±0.25μm
回　差	0.5μm
追从性 ※2	50nm（纳米）
静止时负荷 ※3	100N
移动时负荷 ※3	100N
最高速度	1mm/sec
电　机 ※4	步进：PK525PA（东方马达）
	伺服：HG-AK0236（三菱）
驱　动　器 ※4	步进：MC-S0514-L（MICROSTEP）
	伺服：MR-J4-03A6（三菱）
材　质	铁-镀黑铬
质　量	约1.5kg
润滑剂	低发尘润滑脂

※1 ：添加补偿值后的精度
※2 ：分解能【10nm/pulse】时的应答性
※3 ：垂直等分布负荷
※4 ：可选步进电机、伺服电机

■规格构成

NAFHW1D-100ST03-P-N-03
1 2 3

1 电机式样
P：步进电机　**S**：伺服电机
2 电缆式样
N：固定式　**R**：可动式
3 电缆长度
<步进电机>
03：3m　**05**：5m　**10**：10m
<伺服电机>
02：2m　**05**：5m　**10**：10m

※可选一种

NAFHW3C-16规格

项　目	NAFHW3C-16
行　程	XY轴：±1.4mm、θ轴：±1.4°
平台尺寸	台面：160x160mm 底座：250mmx61mm （H）
绝对定位精度 ※1	XY轴：3μm、θ轴：12sec
重复定位精度	XY轴：±0.35μm、θ轴：±1.5sec
回　差	XY轴：0.7μm、θ轴：3sec
追从性 ※2	50nm（纳米）
静止时负荷 ※3	600N
移动时负荷 ※3	300N
平　行　度	30μm
最高速度	1mm/sec
电　机 ※4	步进：PK525PA（东方马达）
	伺服：HG-AK0236（三菱）
驱　动　器 ※4	步进：MC-S0514-3L（MICROSTEP）
	伺服：MR-J4-03A6（三菱）
材　质	铁-镀黑铬
质　量	约10kg
润滑剂	低发尘润滑脂

※1 ：添加补偿值后的精度
※2 ：分解能【10nm/pulse】时的应答性
※3 ：垂直等分布负荷
※4 ：可选步进电机、伺服电机

■规格构成

NAFHW3C-16-P-N-03
1 2 3

1 电机式样
P：步进电机　**S**：伺服电机
2 电缆式样
N：固定式　**R**：可动式
3 电缆长度
<步进电机>
03：3m　**05**：5m　**10**：10m
<伺服电机>
02：2m　**05**：5m　**10**：10m

※可选一种

本彩页内容可能不经告知随时更改

HEPHAIST
http://www.hephaist.co.jp
http://www.hephaist.com.cn

ヒーハイスト株式会社
本社
〒350-1151埼玉県川越市今福580-1
代　表 TEL +81-49-273-7000　FAX +81-49-273-7001
営业部 TEL +81-49-273-7003　FAX +81-49-273-7006
E-mail:info1@hephaist.co.jp

赫菲(上海)轴承商贸有限公司
上海市浦东新区东方路971号钱江大厦3楼309C室
邮编　200122
电话　+86-21-5113-0323
E-mail: hst-sh@hephaist.com.cn

【咨询 、采购】

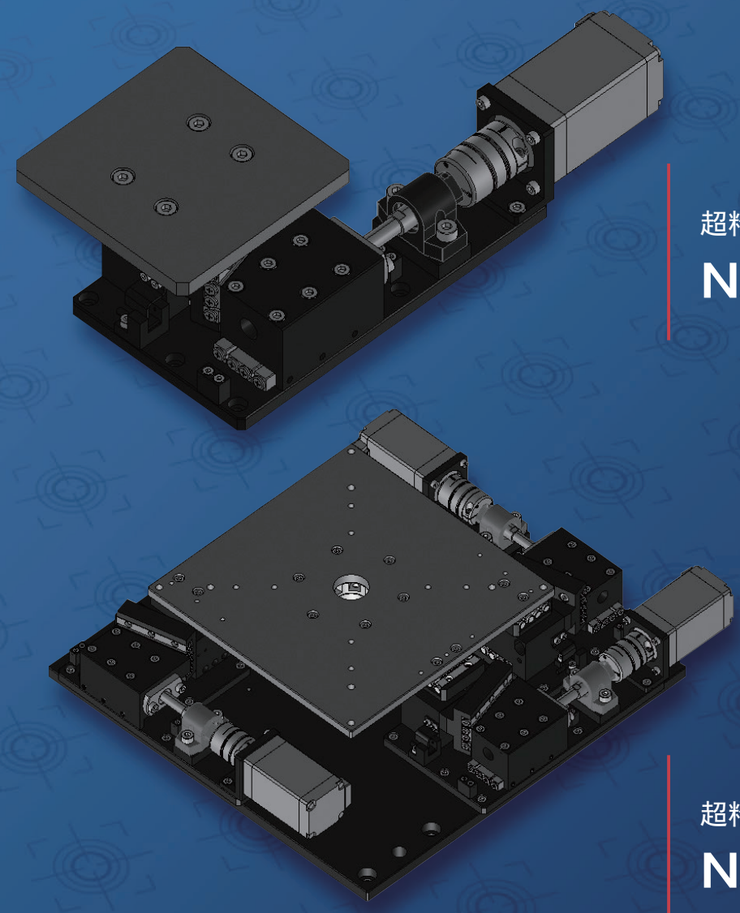
NEW

HEPHAIST

超精密

楔形减速机构　滚珠丝杆　交叉滚子导轨

实现了高精度、高刚性、高追从性的理想平台
HW系列



超精密1轴平台
NAFHW1D-100

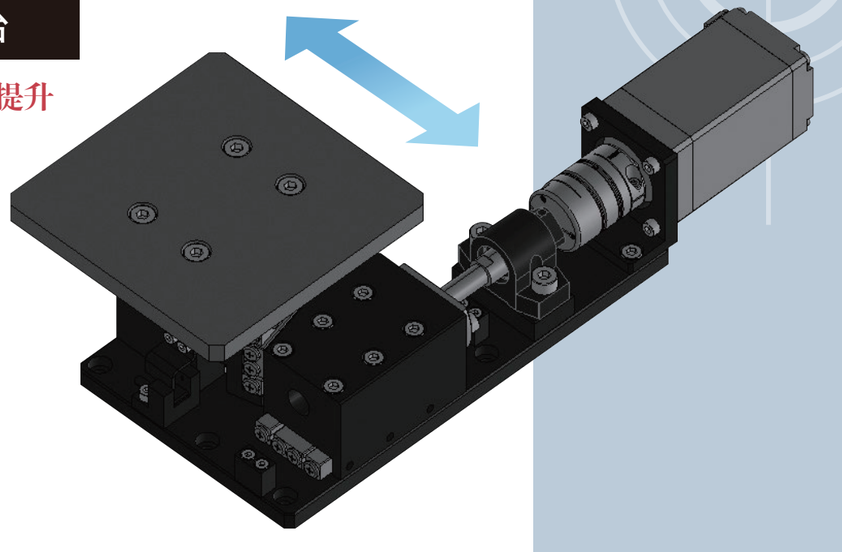
超精密3轴平台
NAFHW3C-16

202105

1

NAFHW 1D-100

超精密一轴平台



采用了新机构令性能得到提升

高分解能
搭载楔形减速机构
提高4倍精度

高精度
实现重复定位「±0.25μm」
绝对精度「3μm」

高追从性
「50nm(纳米)」精度追从性

用途

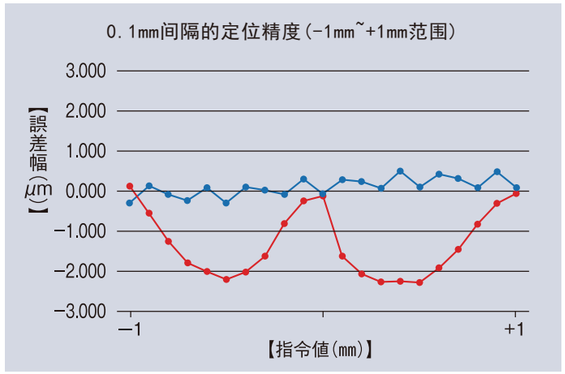
半导体制造装置、各种检测装置、
光学对位装置、
纳米定位装置等等

采用楔形减速机构让下述成为可能

减少滚珠丝杆的运行跳动影响

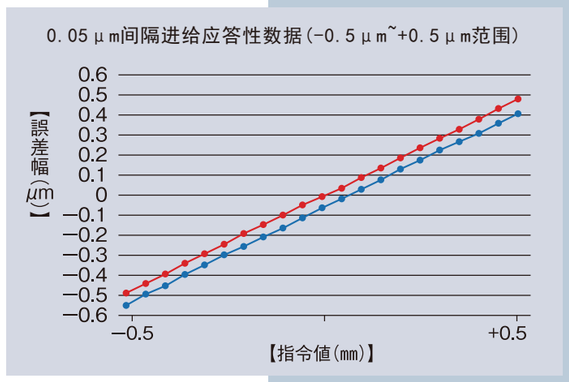
50纳米进给追从性

●[对位误差]测量数据※参考数据



NAFHW1D-100
执行机构(我司旧型号C3等级)

●[追从性]测量数据※参考数据



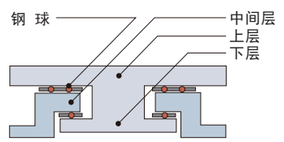
一~+方向(NAFHW1D-100)
+~一方向(NAFHW1D-100)

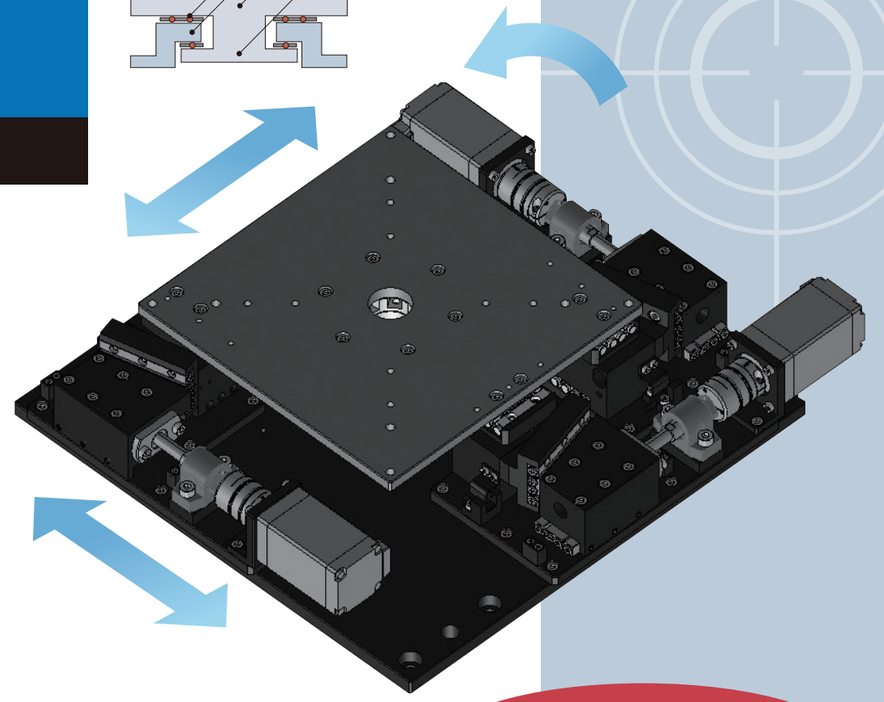
3

NAFHW 3C-16

超精密XYθ平台

预压型
双滑动构造





采用预压型双滑动结构

高刚性
实现了惊人的水平方向刚性

高精度
实现重复定位「±0.25μm」
绝对精度「3μm」

高追从性
「50nm(纳米)」精度追从性

应对高负荷
预压型双滑动结构

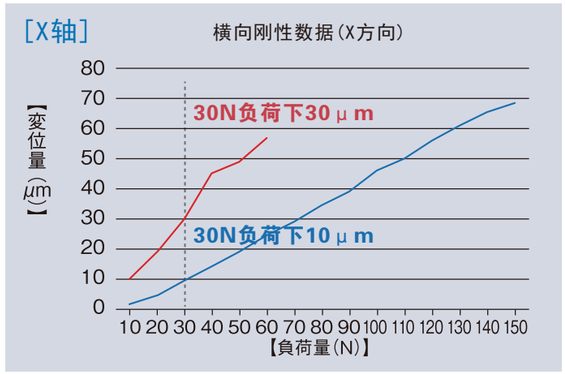
用途

半导体制造装置、各种检测装置、
光学对位装置、
纳米定位装置等等

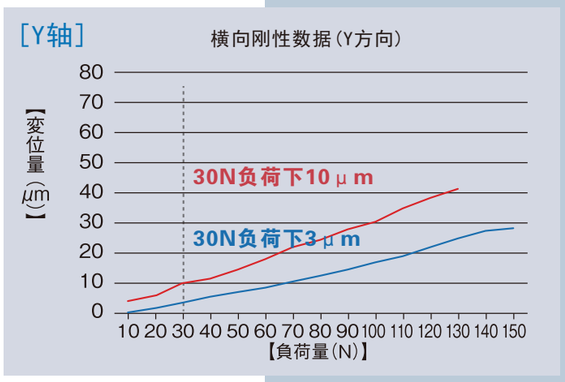
从刚性测量数据可见的高刚性设计

通过楔形机构、执行机构的配置、预压型双滑动结构、
耐负荷设计带来的刚性大幅提高

●[水平方向刚性]测量数据※参考数据



NAFHW3C-16
NAF3C-1(我司旧型号)



NAFHW3C-16
NAF3C-16(我司旧型号)